УДК 621.382.3.001

К. А. Лукин, П. П. Максимов

# ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОЧАСТОТНЫХ АВТОГЕНЕРАТОРОВ МИЛЛИМЕТРОВЫХ И СУБМИЛЛИМЕТРОВЫХ ВОЛН НА ОСНОВЕ *PN-I-PN*-СТРУКТУР

Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАН Украины 12, ул. Ак. Проскуры, Харьков, 61085, Украина E-mail: <u>lukin.konstantin@gmail.com; Lndes@kharkov.com</u>

Исследованы энергетические характеристики многочастотных автогенераторов миллиметровых и субмиллиметровых волн на основе Si и GaAs *pn-i-pn*-структур с резкими *p-n*-переходами и постоянным обратным смещением. В качестве математической модели автогенераторов используются уравнения диффузионно-дрейфовой модели полупроводников. Приведен алгоритм решения разностных уравнений математической модели. Исследована вольтамперная характеристика *pn-i-pn*-структур. Изучена динамика распределения электрического поля, электрического потенциала и суммарного заряда подвижных носителей и примесных атомов в *pn-i-pn*-структуре. Рассчитан фурье-спектр плотности полезной мощности и электронного КПД многочастотных автогенераторов. Ил. 5. Библиогр.: 13 назв.

Ключевые слова: полупроводниковая *pn-i-pn*-структура, ударная ионизация, многочастотные автогенераторы, плотность полезной мощности, электронный КПД.

Одной их актуальных проблем твердотельной электроники является создание многочастотных генераторов миллиметровых (мм) и субмиллиметровых (субмм) волн большой мощности и высоким КПД. Такие генераторы необходимы, например, в нелинейной и многочастотной радиолокации, в геологии для несейсмических методов исследования недр Земли и медицине [1]. Многочастотные автогенераторы могут быть созданы на основе обратносмещенных Si и GaAs *pn-i-pn*-структур с резкими *p-n*-переходами при постоянном обратном смещении [2]. Как известно [3, 4], физическая особенность обратносмещенных pn-i-pn-структур с постоянным обратным смещением заключается в том, что кроме обратной связи внутри слоя умножения *p*-*n*-переходов они имеют внутреннею обратную связь по дрейфовому току между *р*-*n*-переходами. Эта связь обусловлена ударной ионизацией в обоих *p*-*n*-переходах и наличием электрического поля в *i*-области *pn-i-pn*-структуры. Принцип действия многочастотных автогенераторов основан на лавинно-каскадном умножении носителей заряда и взаимозависимости электрического поля и лавинного тока в слоях умножения *p*-*n*-переходов, которая следует из самосогласованного решения уравнения Пуассона и уравнений непрерывности для электронов и дырок. В работе [2] показано, что частота автоколебаний определяется концентрацией примесных атомов, однако энергетические характеристики автогенераторов – мощность и электронный КПД не исследованы.

Целью нашей работы является численное исследование в рамках диффузионно-дрейфовой модели полупроводников (ДДМ) динамики распределения электрического поля, электрического потенциала и суммарного заряда, расчет и анализ вольтамперной характеристики (ВАХ) и энергети-

ISSN 1028-821Х Радиофизика и электроника. 2012. Т. 3(17). № 1

ческих характеристик автогенераторов мм и субмм волн на основе Si и GaAs *pn-i-pn*-структур с резкими *p-n*-переходами в режиме многочастотных автоколебаний.

1. Постановка задачи. Рассматриваемая одномерная модель автогенератора на основе pn-i-pn-структуры с однородно легированными резкими p-n-переходами и внутренней обратной связью по дрейфовому току между ними представлена на рис. 1. Точки  $x_2$  и  $x_5$  – границы раздела p- и n-областей p-n-переходов;  $p_1$  и  $p_2$  – области полупроводника, однородно легированные примесью акцепторов;  $n_1$  и  $n_2$  – области полупроводника, однородно легированные примесью доноров; i-область собственного или слабо легированного полупроводника. Точка  $x_2 = 0$  – начало координат, E – генератор напряжения, R – внутреннее сопротивление генератора напряжения.



Рис. 1. Упрощенная схема автогенератора на основе *pn-i-pn*-структуры

Аппроксимация примесных профилей в p-n-переходах pn-i-pn-структуры соответствует так называемому резкому p-n-переходу со ступенчатым распределением примеси. Такая аппроксимация обеспечивает адекватное приближение для ионно-имплантированных p-n-переходов. Легирование p-n-переходов выполнено таким образом, что число примесных атомов в  $p_1$ - и  $n_2$ -областях

больше, чем в  $p_2$ - и  $n_1$ -областях. Ширина  $n_1$ - и  $p_2$ -областей такая, что в отсутствие внешнего напряжения их обедненные области достигают *i*-области структуры (координат  $x_3$  и  $x_4$ ). В общем случае pn-*i*-pn-структура содержит  $p_1$ - $n_1$ -,  $n_1$ -*i*-, i- $p_2$ - и  $p_2$ - $n_2$ -переходы. Однако контактная разность потенциалов  $n_1$ -*i*- и *i*- $p_2$ -переходов значительно меньше контактной разности потенциалов  $p_1$ - $n_1$ - и  $p_2$ -переходов, поэтому  $n_1$ -*i*- и *i*- $p_2$ -переходов мы не будем рассматривать, считая, что потенциальные барьеры этих переходов.

Рассмотрим переходные процессы. После замыкания ключа *К* на *pn–i–pn*-структуру подается обратное смещение. К омическим контактам *p*-*n*-переходов начинают притекать по внешней цепи заряды, создающие в объеме pn-i-pn-структуры электрическое поле Евн. Это поле вызывает дрейф основных носителей тока к омическим контактам, поэтому часть электронов n2-области и дырок р<sub>1</sub>-области отходят от р<sub>1</sub>-n<sub>1</sub>- и р<sub>2</sub>-n<sub>2</sub>-переходов, обнажая при этом новые слои ионизованных доноров и акцепторов, т. е. расширяя области объемного заряда этих переходов на величину  $\Delta x$ . После компенсации зарядов источника питания практически все приложенное напряжение падает на обедненные области *p*-*n*-переходов, сопротивление которых на много порядков выше сопротивления і-области структуры. По завершению переходных процессов  $p_1$ - $n_1$ -переход будет отрицательно заряженным с зарядом  $Q_1 = -qN_{a1} \Delta x_1$ , а *p*<sub>2</sub>-*n*<sub>2</sub>-переход – положительно заряженным с зарядом  $Q_2 = -qN_{a2} \Delta x_2$ , где  $\Delta x_1$  и  $\Delta x_2$  – увеличение ширины обедненных p<sub>1</sub>- и n<sub>2</sub>-областей за счет обратного смещения. Эти заряды равны по величине, так как для концентраций примесных атомов выполняются равенства [5]  $N_{a1}\Delta x_1 = N_{a2}\Delta x_2$ И  $N_{a1}L'_{p1} = N_{a2}L'_{n2}$ , где  $L'_{p1}, L'_{n2}$  – значения обедненных p<sub>1</sub>- и n<sub>2</sub>-областей в отсутствие обратного смещения на структуре. Очевидно, что наличие двух заряженных *p*-*n*-переходов приведет к появлению

электрического поля 
$$E_i = \frac{q}{\varepsilon \varepsilon_0} N_{a1} \Delta x_1$$
 в *i*-области

*pn–i–pn*-структуры [5]. Статическое электрическое поле резких *p–n*-переходов принимает максимальное значение на границах раздела *p*- и *n*-областей [6, 7]. Это значение равно соответственно

$$E_1 = \frac{q}{\varepsilon \varepsilon_0} N_{a1} x_1$$
 и  $E_2 = \frac{q}{\varepsilon \varepsilon_0} N_{a2} (x_6 - x_5)$ . Когда  $E_1$  и

*E*<sub>2</sub> больше напряжения лавинного пробоя, в *p*-*n*-переходах возникает ударная ионизация.

В качестве математической модели для описания ударной ионизации в резких *p*-*n*-пере-ходах используем уравнения ДДМ. Исходная сис-

тема этих уравнений для  $p_1$ - $n_1$ -перехода имеет следующий вид [6-8]:

$$\frac{\partial E(x,t)}{\partial x} = \frac{q}{\varepsilon \varepsilon_0} [N(x,t)], \quad \frac{\partial \varphi(x,t)}{\partial x} = -E(x,t); \quad (1)$$

$$\frac{\partial n(x,t)}{\partial t} = \frac{1}{q} \frac{\partial J_n}{\partial x} + \alpha_n J_n + \alpha_p J_p - R(n,p); \qquad (2)$$

$$\frac{\partial p(x,t)}{\partial t} = -\frac{1}{q} \frac{\partial J_p}{\partial x} + \alpha_n J_n + \alpha_p J_p - R(n,p); \qquad (3)$$

$$J_{n}(x,t) = qn(x,t)\mu_{n}E(x,t),$$

$$J_{cM}(x,t) = \varepsilon\varepsilon_{0}\frac{\partial E(x,t)}{\partial t},$$

$$J_{p}(x,t) = qp(x,t)\mu_{p}E(x,t);$$

$$(4)$$

$$J(t) = J_n(x,t) + J_p(x,t) + J_{\rm CM}(x,t),$$
(5)

где E – напряженность электрического поля;  $\varphi$  – электрический потенциал; J – плотность полного лавинного тока;  $J_n$  – электронная составляющая плотности лавинного тока;  $J_p$  – дырочная составляющая плотности лавинного тока;  $J_{\rm см}$  – плотность тока смещения; n – концентрация электронов в зоне проводимости; p – концентрация дырок в валентной зоне; q – абсолютное значение заряда электрона;

$$N(x) = \begin{cases} -N_{a1}, x_1 \le x < x_2; N_{d1}, x_2 < x < x_3; \\ 0, x_3 < x < x_4; \\ N_{a2}, x_4 < x < x_5; N_{d2}, x_5 < x \le x_6 \end{cases}$$

распределение концентрации примесных атомов в структуре; N<sub>a</sub>, N<sub>d</sub> – концентрация акцепторов и доноров соответственно;  $\mathcal{E}\mathcal{E}_0$  – диэлектрическая проницаемость полупроводника; є<sub>0</sub> – диэлектрипроницаемость ческая вакуума; N(x,t) = N(x) + p(x,t) - n(x,t) – суммарный заряд примесных атомов N(x) и подвижных носителей p(x,t) - n(x,t); R(n, p) -скорость рекомбинации электронов и дырок [6]; D<sub>n</sub>, D<sub>p</sub> - коэффициенты диффузии электронов и дырок, которые связаны с подвижностями  $\mu_n, \mu_p$  соотношениями Эйнштейна  $\mu_n = D_n / \varphi_0; \quad \mu_p = D_p / \varphi_0; \quad \varphi_0 = kT / q;$ *T* – абсолютная температура; *k* – постоянная Больцмана;  $\alpha_{n,p}(E) = A_{n,p} \exp \left[ -\left(\frac{b_{n,p}}{E}\right)^{m_{n,p}} \right] -$ коэф-

фициенты ударной ионизации для электронов и дырок (параметры A, b и m определяются материалом полупроводника) [8]. Уравнения ДДМ дополняются граничными условиями

$$E(w_{p},t) = 0, E(w_{n},t) = E_{i},$$

$$\varphi(w_{p},t) = V(t), \varphi(w_{n},t) = \varphi_{i}(x_{3},t),$$

$$J_{p}(w_{p},t) = J(t) - J_{ns}(w_{p},t),$$

$$J_{n}(w_{n},t) = J(t) - J_{ps}(w_{n},t),$$
(6)

начальным условием

$$J(w_n, t=0) = J_{ns} \tag{7}$$

и условиями непрерывности электрического поля и потенциала на границе раздела *p*-и *n*-областей

$$E(x,t)|_{x=x_{2}-0} = E(x,t)|_{x=x_{2}+0},$$

$$\varphi(x,t)|_{x=x_{2}-0} = \varphi(x,t)|_{x=x_{2}+0},$$
(8)

где  $w_p$ ,  $w_n$  – координаты обедненных *p*- и *n*-областей  $p_1$ - $n_1$ -перехода;  $J_{ns}$ ,  $J_{ps}$  – плотность электронного и дырочного токов тепловой генерации соответственно;  $V(t) = -\int_{w_p}^{w_n} E(x,t)dx$  – падение напряжения на *p*-*n*-переходе;  $\varphi_i(x_3,t)$  – электрический потенциал на границе *i*-области и  $p_1$ - $n_1$ -перехода.

В *i*-области *pn–i–pn*-структуры происходит дрейф и рекомбинация электронов и дырок. Эти процессы описываются уравнениями (2)–(3), в правой части которых отсутствуют члены, описывающие генерацию электронно-дырочных пар.

Уравнения ДДМ преобразовывались в безразмерные уравнения по формуле  $a' = a/a_0$  (*a* – искомая величина; далее знак « ' » опускаем). Основные нормировочные коэффициенты равны:  $E_0 = \varphi_0/L_0$ , В/м;  $t_0 = L_0^2/D_0$ , с;  $D_0 = 1$ , м<sup>2</sup>/с;  $\varphi_0 = kT/q$ , В;  $L_0 = \sqrt{\varepsilon \varepsilon_0 \varphi_0/q n_i}$ , м;  $J_0 = q n_i D_0/L_0$ , А/м<sup>2</sup> [9]. Для численного интегрирования уравнений ДДМ заменим в них дифференциальные операторы разностными. Погрешность этой аппроксимации не превышает  $O(\tau + h)$  [10].

**2.** Алгоритм решения. Введем в обедненной области *p*-*n*-перехода пространственновременную сетку [10]

$$\omega = \begin{cases} (x_i, t_j), x_{i+1} = x_i + h_i; t_{j+1} = t_j + \tau_j, \\ i = 0, 1, 2, \dots, M; j = 0, 1, 2, \dots, \\ x_0 = w_p(t), x_M = w_n(t), t_0 = 0. \end{cases}$$

Рассмотрим алгоритм решения уравнений (1)–(5). В *p*-области *p*–*n*-перехода для *E* и  $\varphi$ на *j*-м временном слое получаем следующие разностные уравнения:

$$\frac{E_i - E_{i-1}}{h_p} = -N_{pi};$$
(9)

$$\frac{\varphi_i - \varphi_{i-1}}{h_p} = -E_{pi}, \ i = 1, 2, 3, \dots, i_{01}, \tag{10}$$

где  $h_{pi} = h_p = w_{pj}/i_{01}$  — шаг пространственной равномерной сетки в *p*-области; индекс *j* — параметр временной сетки;  $i_{01} = i_0 - 1$ ,  $i_0 -$  число узлов сетки в *p*-области перехода;  $N_{pi}$  — значение суммарного заряда в узле сетки  $(x_i, t_j)$ .

В *n*-области *p*-*n*-перехода для *E* и *φ* на *j*-м временном слое разностные уравнения представим как

$$\frac{E_{i+1} - E_i}{h_n} = N_{ni}; \tag{11}$$

$$\frac{\varphi_{i+1} - \varphi_i}{h_n} = E_i, \ i = M - 1, M - 2, ..., M - i_0, \tag{12}$$

где  $h_{ni} = h_n = w_{nj} / i_{01}$  — шаг пространственной равномерной сетки в *n*-области;  $M = i_0 + i_{01}$ ,  $i_{01} = i_0 - 1$ ,  $i_0$  — число узлов сетки в *n*-области;  $N_{ni}$  — значения суммарного заряда в узле сетки  $(x_i, t_j)$ .

Разностные уравнения (9)–(12) с условиями (6)–(8) разрешаются явным образом с помощью схемы бегущего счета [10]. Искомые сеточные функции для *p*-области запишем

$$E_{pi} = -h_p \sum_{j=2}^{t} N_{pj};$$
 (13)

$$\varphi_{pi} = u - h_p^2 \sum_{j=2}^{i} \sum_{k=2}^{j} N_{pk}, \ i = 2, 3, ..., i_{01}.$$
 (14)

Сеточные функции для *n*-области имеют аналогичный вид

$$E_{M-i} = h_n \sum_{k=M-1}^{M-i} N_{nk};$$
(15)

$$\varphi_{M-i} = -h_n^2 \sum_{j=M-1}^{M-i} \sum_{k=M-1}^{j} N_{nk}, \ i = M - 1, ..., M - i_0.$$
(16)

Условия непрерывности (8) с учетом (13)–(16) принимают вид

$$-h_p \sum_{k=2}^{i_{01}} N_{pk} = h_n \sum_{k=M-1}^{i_{01}} N_{nk}; \qquad (17)$$

$$u + h_p^2 \sum_{j=2}^{i_{01}} \sum_{k=2}^j N_{pk} = -h_n^2 \sum_{j=M-1}^{i_{01}} \sum_{k=M-1}^j N_{nk}.$$
 (18)

Значение шага сетки на *j*-м временном слое для *n*- и *p*-областей находим из (17) и (18) в следующем виде:

$$h_{n} = \sqrt{\frac{-u}{\varphi_{n} - \varphi_{p} e_{n}^{2} / e_{p}^{2}}}, \ h_{p} = -h_{n} e_{n} / e_{p};$$
(19)

$$e_p = \sum_{k=2}^{i_{01}} N_{pk}, e_n \sum_{k=M-1}^{i_{01}} N_{nk};$$
(20)

$$\varphi_p = \sum_{j=2}^{i_{01}} \sum_{k=2}^{j} N_{pk}, \, \varphi_n = \sum_{j=M-1}^{i_{01}} \sum_{k=M-1}^{j} N_{nk}.$$
(21)

Для плотности электронного и дырочного токов на j+1 временном слое получаем полунеявные разностные уравнения

$$J_{ni+1}^{j+1} = [J_{ni}^{j} - \sigma_n J_{ni}^{j+1} + v_n \tau_n \alpha_i^{j} (J_{ni}^{j} + J_{pi}^{j})] / \gamma_n; \quad (22)$$

$$J_{pi-1}^{j+1} = [J_{pi}^{j} - \sigma_{p} J_{pi}^{j+1} + v_{p} \tau_{p} \alpha_{i}^{j} (J_{ni}^{j} + J_{pi}^{j})] / \gamma_{p}, \quad (23)$$

где

$$\gamma_n = v_n \tau_n h_n; \gamma_p = v_p \tau_p h_p; \sigma_n = 1 - \gamma_n; \sigma_p = 1 - \gamma_p.$$

Из формулы (19) следует, что при фиксированном числе узлов сетки ( $i_0 = \text{const}$ )  $h_p$  и  $h_n$ определяются значениями электрического поля и потенциала. Размеры областей объемного заряда акцепторов в *p*-области и доноров в *n*-области *p*-*n*-перехода на *j*-м временном слое равны соответственно

$$w_p^J = h_p i_{01}; w_n^J = h_n i_{01}.$$
 (24)

Из (24) следует, что границы обедненной области  $w_p$  и  $w_n$  подвижны, если  $h_p$  и  $h_n$  зависят от времени, т. е. если суммарный заряд *p*- и *n*-областей (20) изменяется со временем. При неравномерной разностной сетке  $h_p$  и  $h_n$  зависят от номера ее узла. В этом случае  $h_{pi}$  и  $h_{ni}$  следует определять в каждом узле сетки [10].

Решение разностных уравнений находим следующим образом [11]. Сначала определяем распределение суммарного заряда N(x,t) в обедненной области *p*–*n*-перехода ( $N(x,t_0) = N(x)$ ). По известному распределению зарядов из разностного уравнения Пуассона рассчитываем суммы (20) и (21). Затем по формулам (19) определяем шаг сетки в обедненной области  $h_p$  и  $h_n$ . Наконец по формулам (13)–(16), (22) и (23) находим искомые величины на *j*+1 временном слое и переходим к их определению на *j*+2 временном слое и т. д. Решение считается найденным, если искомые величины определены во всех узлах пространственно-временной сетки.

Лавинный ток на выходе из  $p_1-n_1$ -перехода поступает в *i*-область структуры, где его дрейф и рекомбинация электронов описываются разностным уравнением (22), в котором коэффициенты ударной ионизации равны нулю. Далее этот ток инжектируется в  $p_2-n_2$ -переход, как ток неосновных носителей, где он инициирует ударную ионизацию в слое умножения перехода. Лавинные процессы в  $p_2-n_2$ -переходе описываются теми же разностными уравнениями, что и в  $p_1-n_1$ -переходе и т. д. [11].

**3.** Вольтамперная характеристика. На рис. 2 приведена вольтамперная характеристика Si pn-i-pn-структуры с учетом влияния лавинного тока на электрическое поле p-n-переходов. Первичная ударная ионизация в  $p_1-n_1$ -переходе инициируется темновым током  $J_{ns}$ . Видно, что эта характеристика имеет 4 характерные зоны.



Рис. 2. Вольтамперная характеристика Si pn-i-pn-структуры (J, кА/см<sup>2</sup>;  $N_a = 2 \cdot 10^{17}$  см<sup>-3</sup>;  $N_d = N_a$ )

В зоне 1 ( $U/U_{av} \le 0,8$ ) электрическое поле не достаточно, чтобы в *p*-*n*-переходах возникла ударная ионизация, поэтому лавинный ток равен нулю.

В узком интервале напряжений  $(0,80 < U/U_{av} \le 0,82)$  лежит зона 2. В этой зоне лавинный ток экспоненциально растет, но его величина остается значительно меньше величины предельного тока *p*-*n*-перехода, поэтому он практически не влияет на электрическое поле. Зона экспоненциального нарастания лавинного тока описывается нелинейной теорией лавиннопролетных диодов [7].

В зоне З  $(0,82 < U/U_{av} \le 1,14)$  лавинный ток достигает значений, при которых его заряд подвижных носителей становится сравнимым по величине с зарядом примесных атомов. В результате происходит частичная компенсация заряда примесных атомов, поэтому электрическое поле снижается, коэффициенты ударной ионизации уменьшаются, рост лавинного тока замедляется. В этой зоне наблюдается нелинейное усиление.

В зоне 4 ( $U/U_{av} > 1,14$ ) лавинный ток достигает значений, при которых он сравним по величине с предельным током *p*–*n*-переходов, в Si *pn*–*i*–*pn*-структуре возбуждаются многочастотные автоколебания [2]. Таким образом, в Si *pn–i–pn-*структуре в зависимости от величины обратного смещения имеют место режимы экспоненциального и нелинейного усиления и режим многочастотных авто-колебаний. Выбор режима работы определяется величиной напряжения на Si *pn–i–pn-*структуре.

**4.** Автоколебания в Si pn-i-pn-структуре. Выше показано, что в обратносмещенных Si pn-i-pn-структурах с положительной обратной связью по дрейфовому току режим автоколебаний возможен при постоянном напряжении на p-n-переходе  $U/U_{av} > 1,14$  [2]. Процесс развития и установления автоколебаний в Si pn-i-pn-структуре при напряжении на p-n-переходах  $U/U_{av} = 1,2$  иллюстрирует рис. 3.



Рис. 3. Развитие и установление автоколебаний в Si *pn–i–pn*-структуре ( $U/U_{av} = 1,2; d_i/L_{pdif} = 0,5; N_{a1} = 7,5 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}; N_{d1} = 6 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}; N_{a2} = N_{d1}; N_{d2} = N_{a1}; L_{pdif} = 0,9$  мкм; *J*, кА/см<sup>2</sup>; *E*, кВ/см)

Зависимость от времени электрического поля приведена для точки  $x_5$ , а плотности лавинного тока – на выходе  $p_2$ - $n_2$ -перехода. Видно, что на начальном этапе 1 плотность лавинного тока равна нулю, поэтому электрическое поле постоянно. На этапе 2 в результате лавинно-каскадного усиления лавинный ток экспоненциально нарастает. Его заряд частично компенсирует заряд примесных атомов, поэтому электрическое поле уменьшается. Этот эффект наблюдается экспериментально [7]. На этапе 3 наблюдается периодическое нарастание максимальной амплитуды автоколебаний электрического поля и плотности лавинного тока. На этапе 4 происходит насыщение амплитуды автоколебаний вследствие ограничения величины электрического поля зарядом подвижных носителей [2].

Видно, что в режиме установившихся автоколебаний в Si pn-i-pn-структуре максимальное значение лавинного тока равно  $J(t) = 58,63 \text{ кA/cm}^2$ , что сравнимо по величине с предельным током p-n-перехода  $J_{nlim} = 57,6 \text{ кA/cm}^2$ .

На рис. 4 приведены распределения электрического поля E(x), электрического потенциала  $\varphi(x)$  и суммарного заряда N(x,t) в обедненных областях  $j_1$ - и  $j_2$ -переходов Si pn-i-pn-структуры  $(U/U_{av} = 1,2; d_i/L_{pdif} = 0,5; N_{a1} = 7,5\cdot10^{16} \text{ см}^{-3}; N_{d1} = 6\cdot10^{16} \text{ см}^{-3}; N_{d2} = N_{d1}; N_{d2} = N_{a1}; n_i = 1,6\cdot10^{10} \text{ см}^{-3}; L_{pdif} = 0,9$  мкм;  $J_{nlim} = 57,6 \text{ кА/см}^2$ ) в пяти эквидистантных моментах времени одного полупериода колебаний (кривые 1–5).

Видно, что для E(x) и  $\varphi(x)$  (рис. 4, а, б) выполняются граничные условия на границах обедненной области *p*-*n*-переходов и условия непрерывности на границе раздела р- и п-областей. Электрическое поле максимально тогда, когда в уравнении Пуассона суммарный заряд максимален, и минимально, когда этот заряд минимален (рис. 4, а, в). Это согласуется с результатами работы [2], в которой показано, что суммарный заряд N(x,t) максимален, когда заряд подвижных носителей минимален (компенсация объемного заряда примесных атомов зарядом подвижных носителей минимальна), и минимален, когда заряд подвижных носителей максимален (компенсация объемного заряда примесных атомов зарядом подвижных носителей максимальна). Из рис. 4, а видно, что в *i*-области структуры электрическое поле постоянно  $E_i = 4,1$  кВ/см, так как влияние заряда лавинного тока на поле в этой области не учитываем. Это оправдано тем, что при сильных электрических полях скорость носителей заряда достигает скорости насыщения, поэтому время дрейфа электронов и дырок в *i*-области структуры практически не изменится при учете этого влияния. Видно также, что размер *i*-области структуры меньше размера обедненной области переходов, поэтому рекомбинационными процессами в і-области пренебрегаем.



Рис. 4. Динамика распределения электрического поля E(x), кВ/см, электрического потенциала  $\varphi(x)$ , В, и суммарного заряда  $N(x) = N(x) \cdot n_i \cdot 10^{-22} \text{ см}^{-3}$  в обедненной области  $p_2 - n_2$ -перехода Si pn - i - pn-структуры в пяти эквидистантных моментах времени одного полупериода колебаний

5. Частота, мощность и электронный КПД. В работе [2] отмечено, что решения уравнений ДДМ являются функциями с неравноотстоящими значениями времени, поэтому для спектрального анализа эти функции были предварительно преобразованы в функции с равноотстоящими значениями времени.

На рис. 5 показаны спектры плотности полезной мощности и электронного КПД автогенераторов на основе Si и GaAs *pn–i–pn*-структур с высокой концентрацией примесных атомов.



Рис. 5. Спектральная плотность полезной мощности P(f), кВт/см<sup>2</sup>, автогенераторов: а) – на основе Si p-n-переходов ( $U/U_{av} = 1,06$ ;  $N_{a1} = 7,5 \cdot 10^{17}$  см<sup>-3</sup>;  $N_{d1} = 6 \cdot 10^{17}$  см<sup>-3</sup>;  $N_{a2} = N_{d1}$ ;  $N_{d2} = N_{a1}$ ); б) – на основе GaAs p-n-переходов ( $U/U_{av} = 0,825$ ;  $N_{a1} = 4 \cdot 10^{17}$  см<sup>-3</sup>;  $N_{d1} = 2 \cdot 10^{17}$  см<sup>-3</sup>;  $N_{a2} = N_{a1}$ )

Частота дискретизации и шаг частоты дискретизации соответственно равны для Si pn-i-pn-струк-туры  $f_d = 32,432$  ГГц и  $f_{sd} = 0,54$  ГГц, а для GaAs pn-i-pn-структуры –  $f_d = 75,48$  ТГц и  $f_{sd} = 0,84$  ГГц. Число временных отсчетов равно  $N = 60\ 000$ . При равном N различие в величинах частоты дискретизации и шага частоты дискретизации (погрешности определения частоты) кремниевых и арсенид галлиевых структур обусловлено тем, что дрейфовая скорость электронов в GaAs выше, чем у Si. Поэтому шаг интегрирования  $\tau$  меньше у GaAs, чем у Si-структур, а частота дискретизации равна  $f_d = 1/\tau$ . Видно, что спектр выходного сигнала (см. рис. 3) состоит из набора

несоизмеримых дискретных частот. Положение спектральных линий на оси частот определяется внутренней обратной связью по дрейфовому ток между *p*–*n*-переходами, благодаря которой в формировании сигнала участвуют электроны и дырки, имеющие различные дрейфовые скорости.

В диодах СВЧ минимальная площадь резкого *p*-*n*-перехода равна  $S = 0,2 \cdot 10^{-3}$  см<sup>2</sup> [12]. Из рис. 5 видно, что для этого значения *S* максимальная полезная мощность Si и GaAs автогенераторов в мм диапазоне равна соответственно  $P(116,8 \Gamma \Gamma \mu) = 100$  Вт и  $P(203 \Gamma \Gamma \mu) = 124$  Вт, а в субмм диапазоне –  $P(308 \Gamma \Gamma \mu) = 61$  Вт и  $P(352 \Gamma \Gamma \mu) = 52$  Вт.

Как известно, электронный КПД автогенераторов определяется выражением  $\eta_e = P(f)/P(0) \cdot 100$  %, где P(f) – плотность полезной мощности, P(0) – плотность потребляемой мощности [7]. Представленные на рис. 5 кремниевые и арсенид галлиевые автогенераторы имеют потребляемые мощности соответственно 756 и 656 Вт.

Как известно [8, 13], такие высокие уровни мощности (сотни ватт) достигаются в лавиннопролетных диодах в аномальном режиме, в режиме с захваченной плазмой и в режиме одновременной генерации на двух частотах. Мощные диоды работают в импульсном режиме, параметры которого определяются исходя из граничной температуры [12]. Максимальный электронный КПД исследованных автогенераторов в мм диапазоне равен соответственно  $\eta_e = 13,3$  % и  $\eta_e = 19$  %, а в субмм диапазоне –  $\eta_e = 8,1$  % и  $\eta_e = 8$  %. Уменьшение электронного КПД с повышением частоты обусловлено снижением плотности полезной мощности P(f). С уменьшением заряда примесных атомов потребляемая мощность снижается. При U/U<sub>av</sub> < 1 автоколебания в p-n-переходах не возбуждаются, лавинно-генераторная Si pn-i-pn-структура работает, как лавиннопролетный диод с внутренней обратной связью.

Таким образом, спектр многочастотных автоколебаний в pn-*i*-pn-структурах зависит от материала полупроводника. По сравнению с Si-структурой, спектральные линии GaAs-структуры являются более широкими. Это связано с тем, что дрейфовая скорость электронов в арсениде галлия выше, чем у кремния, поэтому время дрейфа в пролетных участках меньше, а полоса частот шире.

**Выводы.** Таким образом, в режиме многочастотных автоколебаний *pn–i–pn*-структур спектр выходного сигнала состоит из несоизмеримых дискретных частот в мм и субмм диапазонах. Положение спектральных линий на оси частот зависит от материала полупроводника, так как оно определяется внутренней обратной свя-

зью по дрейфовому току между *p*-*n*-переходами, благодаря которой в формировании сигнала участвуют электроны и дырки, имеющие различные дрейфовые скорости.

Рассчитаны энергетические характеристики многочастотных автоколебаний в Si и GaAs *pn–i–pn*-структурах с резкими *p–n*-переходами. Показано, что полезная мощность в мм диапазоне измеряется сотнями ватт, электронный КПД достигает 19 %.

Результаты работы могут быть использованы для создания на основе Si и GaAs *pn–i–pn*-структур мощных импульсных многочастотных автогенераторов мм и субмм диапазонов, которым в настоящее время нет аналогов в электроники СВЧ.

- Вернигоров Н. С. К вопросу о применении многочастотного сигнала в нелинейной радиолокации / Н. С. Вернигоров, А. Р. Борисов, В. Б. Харин // Радиотехника и электрон. – 1998. – <u>41</u>, № 1. – С. 63–66.
- Лукин К. А. Многочастотные автоколебания в полупроводниковых структурах с двумя связанными лавинными *p*-*n*-переходами / К. А. Лукин, П. П. Максимов // Радиофизика и электрон.: сб. науч. тр. / Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – Х., 2009. – <u>14</u>, № 1 – С. 81–87.
- Lukin K. A. Current Oscillations in Avalanche Particle Detectors with pn-i-pn-Structure / K. A. Lukin, H. A. Cerdeira, A. A. Colavita // IEEE Transactions on Electron Devices. – 1996. – 43, N 3. – P. 473–478.
- Lukin K. A. Chaotic instability of currents in a reverse biased multilayered structure / K. A. Lukin, H. A. Cerdeira, A. A. Colavita // Appl. Phys. Lett. – 1997. – <u>71</u>, N 17. – P. 2484–2486.
- Лукин К. А. Статические электрические поля в обратносмещенных *pn-i-pn*-структурах / К. А. Лукин, П. П. Максимов // Радиофизика и электрон.: сб. науч. тр. / Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – Х., 2002. – <u>7</u>, № 2. – С. 317–322.
- Зи С. Физика полупроводниковых приборов: в 2 кн. Кн. 2 / С. Зи; пер. с англ. под ред. Р. А. Суриса. – М.: Мир, 1984. – 456 с.
- Тагер А. С. Лавинно-пролетные диоды и их применение в технике СВЧ / А. С. Тагер, В. М. Вальд-Перлов. – М.: Сов. радио, 1968. – 480 с.
- Кэррол Дж. СВЧ-генераторы на горячих электронах / Дж. Кэррол; пер. с англ. под ред. Б. Л. Гельмонта. – М.: Мир, 1972. – 384 с.
- Польский В. С. Численное моделирование полупроводниковых приборов / В. С. Польский. – Рига: Зинатие, 1986. – 168 с.
- Самарский А. А. Разностные методы решения задач газовой динамики / А. А. Самарский, Ю. П. Попов. М.: Наука, 1980. 352 с.
- Максимов П. П. Алгоритм решения уравнений диффузионно-дрейфовой модели полупроводниковых структур с лавинными *p*-*n*-переходами / П. П. Максимов // Радиофизика и электрон.: сб. науч. тр. / Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – Х., 2008. – <u>13</u>, № 3. – С. 523–528.
- 12. Влияние перегрева *p*-*n*-перехода на деградацию мощных импульсных кремниевых лавинно-пролетных диодов / А. Е. Беляев, В. В. Басанец, Н. С. Болтовец и др. // Физика и техника полупроводников. – 2011. – <u>45</u>, вып. 2. – С. 256–262.
- Вальд-Перлов В. М. Лавинно-пролетный диод // Большая Сов. Энцикл.: в 30 т. Т. 14 / В. М. Вальд-Перлов. – М.: Сов. энцикл., 1973. – С. 87.

Рукопись поступила 05.09.2011.

### K. A. Lukin, P. P. Maksymov

# RESEARCH OF POWER CHARACTERISTICS OF MULTIFREQUENCY GENERATORS OF MICROWAVES ON THE BASIS OF *PN–I–PN-*STRUCTURES

The power characteristics of multifrequency generators of millimeter and sub-millimeter waves on the basis of Si and GaAs pn-*i*-pn-structures with abrupt p-n-junctions and permanent reversed bias are explored. As a mathematical model of generators equations of diffusive-drifting model of semiconductors are used. The algorithm of decision of difference equations of diffusive-drifting model is given. Volt-Ampere characteristic of Si pn-*i*-pn-structures is studied. The dynamics of distributing of the electric field, electric potential and total charge of mobile carriers and admixtures atoms in pn-*i*-pn-structure are explored. Fourier spectrum of density of useful power and electronic efficiency of multifrequency generators is calculated.

**Key words:** semiconductor *pn–i–pn-*structure, impact ionization, multifrequency oscillators, closeness of useful power, electronic efficiency.

#### К. О. Лукін, П. П. Максимов

# ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БАГАТОЧАСТОТНИХ АВТОГЕНЕРАТОРІВ МІЛІМЕТРОВИХ І СУБМІЛІМЕТРОВИХ ХВИЛЬ НА ОСНОВІ *РN–І–РN-*СТРУКТУР

Досліджено енергетичні характеристики багаточастотних автогенераторів міліметрових і субміліметрових хвиль на основі Si i GaAs *pn-i-pn*-структур з різкими *p-n*-переходами і постійним зворотним зсувом. Як математична модель автогенераторів використовуються рівняння дифузійнодрейфової моделі напівпровідників. Приведено алгоритм розв'язання різницевих рівнянь дифузійно-дрейфової моделі. Досліджено вольтамперну характеристику *pn-i-pn*-структур. Вивчено динаміку розподілу електричного поля, електричного потенціалу і сумарного заряду рухомих носіїв і домішкових атомів в *pn-i-pn*-структурі. Розраховано фур'є-спектр частотних автогенераторів.

Ключові слова: напівпровідникова *pn-i-pn-*структура, ударна іонізація, багаточастотні автогенератори, щільність корисної потужності, електронний ККД.